

(以下附錄節錄自中華人民共和國財政部的網站，全文可參閱
http://szs.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcefabu/201911/t20191114_3422652.html)

附錄

关于继续执行研发机构采购设备增值税政策的公告 财政部 商务部 税务总局公告 2019 年第 91 号

为了鼓励科学研究和技术开发，促进科技进步，继续对内资研发机构和外资研发中心采购国产设备全额退还增值税。现将有关事项公告如下：

一、适用采购国产设备全额退还增值税政策的内资研发机构和外资研发中心包括：

(一) 科技部会同财政部、海关总署和税务总局核定的科技体制改革过程中转制为企业和进入企业的主要从事科学研究和技术开发工作的机构；

(二) 国家发展改革委会同财政部、海关总署和税务总局核定的国家工程研究中心；

(三) 国家发展改革委会同财政部、海关总署、税务总局和科技部核定的企业技术中心；

(四) 科技部会同财政部、海关总署和税务总局核定的国家重点实验室（含企业国家重点实验室）和国家工程技术研究中心；

(五) 科技部核定的国务院部委、直属机构所属从事科学研究工作的各类科研院所，以及各省、自治区、直辖市、计划单列市科技主管部门核定的本级政府所属从事科学研究工作的各类科研院所；

(六) 科技部会同民政部核定或者各省、自治区、直辖市、计划单列市及新疆生产建设兵团科技主管部门会同同级民政部门核定的科技类民办非企业单位；

(七) 工业和信息化部会同财政部、海关总署、税务总局核定的国家中小企业公共服务示范平台（技术类）；

(八) 国家承认学历的实施专科及以上高等学历教育的高等学校（以教育部门门户网站公布名单为准）；

(九) 符合本公告第二条规定的外资研发中心；

(十) 财政部会同国务院有关部门核定的其他科学研究机构、技术开发机构和学校。

二、外资研发中心，根据其设立时间，应分别满足下列条件：

(一) 2009 年 9 月 30 日及其之前设立的外资研发中心，应同时满足下列条件：

1. 研发费用标准：(1) 对外资研发中心，作为独立法人的，其投资总额不低于 500 万美元；作为公司内设部门或分公司的非独立法人的，其研发总投入不低于 500 万美元；(2) 企业研发经费年支出额不低于 1000 万元。

2. 专职研究与试验发展人员不低于 90 人。

3. 设立以来累计购置的设备原值不低于 1000 万元。

(二) 2009 年 10 月 1 日及其之后设立的外资研发中心，应同时满足下列条件：

1. 研发费用标准：作为独立法人的，其投资总额不低于 800 万美元；作为公司内设部门或分公司的非独立法人的，其研发总投入不低于 800 万美元。

2. 专职研究与试验发展人员不低于 150 人。

3.设立以来累计购置的设备原值不低于 2000 万元。

外资研发中心须经商务主管部门会同有关部门按照上述条件进行资格审核认定。具体审核认定办法见附件 1。在 2018 年 12 月 31 日（含）以前，初次取得退税资格或通过资格复审未满足 2 年的，可继续享受至 2 年期满。

三、经核定的内资研发机构、外资研发中心，发生重大涉税违法失信行为的，不得享受退税政策。具体退税管理办法由税务总局会同财政部另行制定。相关研发机构的牵头核定部门应及时将内资研发机构、外资研发中心的新设、变更及撤销名单函告同级税务部门，并注明相关资质起止时间。

四、本公告的有关定义。

（一）本公告所述“投资总额”，是指商务主管部门发放的外商投资企业批准证书或设立、变更备案回执等文件所载明的金额。

（二）本公告所述“研发总投入”，是指外商投资企业专门为设立和建设本研发中心而投入的资产，包括即将投入并签订购置合同的资产（应提交已采购资产清单和即将采购资产清单）。

（三）本公告所述“研发经费年支出额”，是指近两个会计年度研发经费年均支出额；不足两个完整会计年度的，可按外资研发中心设立以来任意连续 12 个月的实际研发经费支出额计算；现金与实物资产投入应不低于 60%。

（四）本公告所述“专职研究与试验发展人员”，是指企业科技活动中专职从事基础研究、应用研究和试验发展三类项目活动的人员，包括直接参加上述三类项目活动的人员以及相关专职科技管理人员和为项目提供资料文献、材料供应、设备的直接服务人员，上述人员须与外资研发中心或其所在外商投资企业签订 1 年以上劳动合同，以外资研发中心提交申请的前一日人数为准。

（五）本公告所述“设备”，是指为科学研究、教学和科技开发提供必要条件的实验设备、装置和器械。在计算累计购置的设备原值时，应将进口设备和采购国产设备的原值一并计入，包括已签订购置合同并于当年内交货的设备（应提交购置合同清单及交货期限），上述采购国产设备应属于本公告《科技开发、科学研究和教学设备清单》所列设备（见附件 2）。对执行国产设备范围存在异议的，由主管税务机关逐级上报税务总局商财政部核定。

五、本公告规定的税收政策执行期限为 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，具体从内资研发机构和外资研发中心取得退税资格的次月 1 日起执行。《财政部 商务部 国家税务总局关于继续执行研发机构采购设备增值税政策的通知》（财税〔2016〕121 号）同时废止。

附件：1. 外资研发中心采购国产设备退税资格审核认定办法
2. 科技开发、科学研究和教学设备清单

财政部 商务部 税务总局
2019 年 11 月 11 日

附件 1：

外资研发中心采购国产设备退税资格审核认定办法

为落实好外资研发中心（包括独立法人和非独立法人研发中心，以下简称研发中心）采购国产设备相关税收政策，特制定以下资格审核认定办法：

一、资格条件的审核

（一）各省、自治区、直辖市、计划单列市及新疆生产建设兵团商务主管部门会同同级财政、税务部门（以下简称审核部门），根据本地情况，制定审核流程和具体办法。研发中心应按本通知有关要求向其所在地商务主管部门提交申请材料。

（二）商务主管部门牵头召开审核部门联席会议，对研发中心上报的申请材料进行审核，按照本通知正文第二条所列条件和本审核认定办法要求，确定符合退税资格条件的研发中心名单。

（三）经审核，对符合退税资格条件的研发中心，由审核部门以公告形式联合发布，并将名单抄送商务部（外资司）、财政部（税政司）、国家税务总局（货物和劳务税司）备案。对不符合有关规定的，由商务主管部门根据联席会议的决定出具书面审核意见，并说明理由。上述公告或审核意见应在审核部门受理申请之日起 45 个工作日之内做出。

（四）审核部门每两年对已获得退税资格的研发中心进行资格复审。对于不再符合条件的研发中心取消其享受退税优惠政策的资格。

二、需报送的材料

研发中心申请采购国产设备退税资格，应提交以下材料：

（一）研发中心采购国产设备退税资格申请书和审核表；

（二）研发中心为独立法人的，应提交外商投资企业批准证书或设立、变更备案回执及营业执照复印件；研发中心为非独立法人的，应提交其所在外商投资企业的外商投资企业批准证书或设立、变更备案回执及营业执照复印件；

（三）验资报告及上一年度审计报告复印件；

（四）研发费用支出明细、设备购置支出明细和清单以及通知规定应提交的材料；

（五）专职研究与试验发展人员名册（包括姓名、工作岗位、劳动合同期限、联系方式）；

（六）审核部门要求提交的其他材料。

三、相关工作的管理

（一）在公告发布后，列入公告名单的研发中心，可按有关规定直接向其所在地税务部门申请办理采购国产设备退税手续。

（二）审核部门在共同审核认定研发中心资格的过程中，可到研发中心查阅有关资料，了解情况，核实其报送的申请材料真实性。同时应注意加强对研发中心的政策指导和服务，提高工作效率。

（三）省级商务主管部门应将《外资研发中心采购设备免、退税资格审核表》有关信息及时录入外商投资综合管理信息系统研发中心选项。

附：外资研发中心采购设备免、退税资格审核表

附：

外资研发中心采购设备免、退税资格审核表

编码：

研发中心名称				
设立批准/备案机关				
组织机构代码/统一社会信用代码		研发中心设立日期	年 月 日	
研发中心性质	<input type="checkbox"/> 独立法人 <input type="checkbox"/> 分公司 <input type="checkbox"/> 内设部门			
联系人		电话		传真
经营范围				
研发领域 (可多选)	<input type="checkbox"/> 电子 <input type="checkbox"/> 生物医药 <input type="checkbox"/> 新能源 <input type="checkbox"/> 新材料 <input type="checkbox"/> 环保 <input type="checkbox"/> 汽车 <input type="checkbox"/> 化工 <input type="checkbox"/> 农业 <input type="checkbox"/> 软件开发 <input type="checkbox"/> 专用设备 <input type="checkbox"/> 轻工 <input type="checkbox"/> 其他			
投资总额/研发总投入 (万美元)		专职研究与试验发展人员 人数		
研发经费年支出额 (万元)		已缴税金 (元)		
累计采购设备原值 (万元)	进口设备			
	采购国产设备			
	总计			
以下由审核部门填写				
审核意见				<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 未通过
各部门签字 (盖章)	商务	财政	海关	税务
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
公告日期	年 月 日			

注：1、外资研发中心为分公司或内设机构的，企业名称和组织机构代码/统一社会信用代码均填写其所在外商投资企业。

2、币种以表内标注为准，金额根据当年人民币汇率平均价计算。

3、已缴税金为自2019年1月1日起，外资研发中心采购符合条件的设备所缴纳的增值税。

附件 2：

科技开发、科学研究和教学设备清单

科技开发、科学研究和教学设备，是指符合《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》（财政部 国家税务总局令第 50 号）第二十一条“固定资产”的相关规定，为科学研究、教学和科技开发提供必要条件的实验设备、装置和器械（不包括中试设备）。具体包括以下四类：

一、实验环境方面

- （一）教学实验仪器及装置；
- （二）教学示教、演示仪器及装置；
- （三）超净设备（如换气、灭菌、纯水、净化设备等）；
- （四）特殊实验环境设备（如超低温、超高温、高压、低压、强腐蚀设备等）；
- （五）特殊电源、光源设备；
- （六）清洗循环设备；
- （七）恒温设备（如水浴、恒温箱、灭菌仪等）；
- （八）小型粉碎、研磨制备设备。

二、样品制备设备和装置

- （一）特种泵类（如分子泵、离子泵、真空泵、蠕动泵、蜗轮泵、干泵等）；
- （二）培养设备（如培养箱、发酵罐等）；
- （三）微量取样设备（如取样器、精密天平等）；
- （四）分离、纯化、浓缩设备（如离心机、层析、色谱、萃取、结晶设备、旋转蒸发器
等）；
- （五）气体、液体、固体混合设备（如旋涡混合器等）；
- （六）制气设备、气体压缩设备；
- （七）专用制样设备（如切片机、压片机、镀膜机、减薄仪、抛光机等），实验用注射、挤出、造粒、膜压设备，实验室样品前处理设备。

三、实验室专用设备

- （一）特殊照相和摄影设备（如水下、高空、高温、低温等）；
- （二）科研飞机、船舶用关键设备；
- （三）特种数据记录设备（如大幅面扫描仪、大幅面绘图仪、磁带机、光盘机等）；
- （四）材料科学专用设备（如干胶仪、特种坩埚、陶瓷、图形转换设备、制版用干板、特种等离子体源、离子源、外延炉、扩散炉、溅射仪、离子刻蚀机，材料实验机等），可靠性试验设备，微电子加工设备，通信模拟仿真设备，通信环境试验设备；
- （五）小型熔炼设备（如真空、粉末、电渣等），特殊焊接设备；
- （六）小型染整、纺丝试验专用设备；
- （七）电生理设备。

四、计算机工作站，中型、大型计算机。